

SMTライン構成

ライン	構成	メーカー	形式	精度	対象部品	各設備の対応基板サイズ	生産可能基板サイズ
1	印刷機	パナソニック	SP60P-MU	±0.025mm	枠サイズ 600X550～736X736	Min 50X50～Max 510X460 T0.6～3.0	Min 100X80～Max 約280X250 T0.6～3.0
	印刷検査機	CKD	VP6000M-V	3σ 2% 体積	解像度XY15μm/7.5μm切り替え Z3μm	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～5.0	↑
	モジュラーマウンター	富士機械	NXT(M3X8 M6X4)	±0.03mmリード部品	0603～□100X90 T25	Min 50X50～Max 548X510 T0.4～4.0	↑
	リフロー炉(N2)	エイテック	NR06-82L50-RLF	-	基板上10mm 下5mm	Min 70X50～Max 600X500(反り防止有)	↑
	外観検査機	マランツ	L22XDL-520	±0.05mm	-	Min 50X50～Max 520X460 T0.6～3.0	↑
2	印刷機(検査機能付き)	パナソニック	SP80P-L	±0.025mm	枠サイズ 600X550～736X736	Min 50X50～Max 510X460 T0.6～3.0	Min 50X80～Max 330X250 T0.6～3.0
	印刷検査機	CKD	VP3000	3σ 10% 体積	解像度XY12μmZ3μm	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～3.0	↑
	高速マウンター	パナソニック	CM88C-M	±0.1mm	1005～□24X24 T6.5	Min 50X50～Max 330X250 T0.6～3.0	↑
	異形マウンター	パナソニック	DT401-F	±0.035mm	1005～□100X90 T25	Min 50X50～Max 510X460 T0.3～3.0	↑
	リフロー炉(N2)	千住金属工業	SNR-825GT II	-	上部10～35mm(基板厚含む)下部10～25mm(可変機能あり)	Min 100X50～Max 400X250(反り防止有)	↑
	外観検査機	マランツ	V22XDL-350L	±0.05mm	基板上40mm下60mm(RGB照明およびML照明の場合は基板上30mm)	Min 50X50～Max 350X250 T0.6～3.0	↑
3	印刷機	パナソニック	NPM-GP/L	2 Cpk ±15.0 μm ±6 σ	枠サイズ 600X550～736X736	Min 50X50～Max 510X510 T0.3～8.0	Min 50X80～Max 330X250 T0.6～3.0
	印刷検査機	CKD	VP3000	3σ 10% 体積	解像度XY12μmZ3μm	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～3.0	↑
	高速マウンター	パナソニック	NPM-WX(2連結)	±0.025 mm: Cpk≧1 (16ヘッド)03015～1005 ±0.025 mm: Cpk≧1 (8ヘッド)0402～1005	03015～□6X6 T3.0(16ノズルヘッド) 0402～□45X45 T12.0(8ノズルヘッド)	Min 50X50～Max 750X610 T0.3～8.0	↑
	異形マウンター	パナソニック	CM401-F	±0.035mm	1005～□100X90 T25	Min 50X50～Max 510X460 T0.3～3.0	↑
	異形マウンター	パナソニック	DT401-F	±0.035mm	1005～□100X90 T25	Min 50X50～Max 510X460 T0.3～3.0	↑
	リフロー炉(N2)	千住金属工業	SNR-1050GT	-	上部10～35mm(基板厚含む)下部5～25mm(可変機能あり)	Min 50X50～Max 500X500(反り防止有)	↑
	外観検査機	マランツ					↑
4	印刷機	ESE	ES-E7	±0.025mm	枠サイズ 650X550～850X850	Min 70X70～Max 700X610 T0.3～8.0	
	印刷検査機	CKD	VP6000XL-V	3σ 2% 体積	解像度XY15μm/7.5μm切り替え Z3μm	Min 50X50～Max 640X640 T0.5～10.0	
	モジュラーマウンター	パナソニック	NPM-WX				
	リフロー炉	千住金属工業	NSR-1065GT	-	上部10～30mm(基板厚含む)下部5～25mm(可変機能あり)	Min 70X50～Max 700X650(反り防止無)	
	外観検査機	マランツ	U22XJDL-650LH				
5	印刷機	天竜精機	TSP1200	±0.015mm	枠サイズ 736X736～800X800	Min 50X50～Max 640X460 T0.6～4.0 ※注1	Min 85X80～Max 640X460 T0.6～3.0
	印刷検査機	CKD	VP6000L-V-C	3σ 2% 体積	解像度XY15μm/7.5μm切り替え Z3μm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～5.0	↑
	高速マウンター	パナソニック	CM402-L	±0.05mm	0603～□24X24 T6.5	Min 85X80～Max 650X460 T0.3～3.0	↑
	異形マウンター	パナソニック	DT401-F	±0.035mm	1005～□100X90 T25	Min 85X80～Max 650X460 T0.3～3.0	↑
	リフロー炉(N2)	千住金属工業	SNR-1050GT	-	上部10～35mm(基板厚含む)下部5～25mm(可変機能あり)	Min 50X50～Max 640X500(反り防止有)	↑
	外観検査機	マランツ	U22X-FDL-650L	±0.05mm	-	Min 50X50～Max 650X550 T0.5～3.0	↑
その他の設備	N2発生装置	大陽日酸	TNGSH-63-RE80FE/NV	-	-	-	
	塗布機	ヤマハ	HSG-Xg	±0.1mm	1608～	Min 50X50～Max 460X440 T0.3～3.0	
	恒温槽	yamato	DN-42	0℃～210℃	-	-	
	恒温槽	yamato	DN-43	0℃～210℃	-	-	
	McDRY	ERC	DXU-1001	740W	-	-	
	McDRY	ERC	DXU-501	370W	-	-	
	X線検査装置	ビームセンス	FLEX-M863	-	-	Min 50X50～Max 340X260	
	X線検査装置	ノードソン	QUADRA 3	-	-	Max660X550(テーブルトレイサイズ)	407X445(最大検査エリア)
	X線チップカウンター	TECHVALLEY	HAWKEYE1000	99.9%	180mm～380mm・スティック・トレイ ※注3	-	
	半田膜厚検査機	マルコム	TD-3	-	-	Min 50X50～Max 330X250 T0.5～2.0	
	攪拌機	シンキー	SR-500	-	-	-	
	フィクスチャレステスター	タカヤ	APT-7400CJ	-	-	Min50×50～Max640×460 T0.6～3.0	
	外観検査機	マランツ	U22X-FMA350	±0.03mm	-	Min 50X50～Max 350X250 T0.5～3.0	
	外観検査機	マランツ	U22X-FMA650	±0.03mm	-	Min 50X50～Max 650X550 T0.5～3.0	
レーザーマーカー	M/XL兼用マガジン式基板供給装置	小松電子	ELB23XC	-	基板反り 最大±2.0mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0	
	レーザーマーキング装置		LMK08X-K	±0.5mm	基板反り 最大±1.0mm	Min 70X50～Max 510X460 T0.5～2.0	
	駆動式基板クリーナー		ECU46XCD	-	基板反り 最大±0.5mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0	
	基板反転機		EF100X-K	-	基板反り 最大±2.0mm	Min 70X50～Max 510X460 T0.5～2.0	
	レーザーマーキング装置		LMK08X-K	±0.5mm	基板反り 最大±1.0mm	Min 70X50～Max 510X460 T0.5～2.0	
	駆動式基板クリーナー		ECU46XCD	-	基板反り 最大±0.5mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0	
	M/XL兼用マガジン式基板収納装置		EUB23XC	-	基板反り 最大±2.0mm	Min 50X50～Max 510X460 T0.5～2.0	

※注1 両面実装基板で裏面の実装密度が高い場合、又FPC基板等は、サポート方法に別途打合せが必要となります。

※注2 リフローチェッカーの幅がMin80mmです。

※注3 サイズ、形状によって測定不可部品もあります。